

Toilet system, particularly for vehicles

Patent Number: ☐ EP1063167; A3

Publication date: 2000-12-27

Inventor(s): HEINRICH HANS-JUERGEN (DE); GIENKE TORSTEN (DE); ERDMANN WOLFGANG (DE)

Applicant(s): EADS AIRBUS GMBH (DE)

Requested Patent: ☐ DE19928894

Application Number: EP20000112925 20000620

Priority Number(s): DE19991028894 19990624

IPC Classification: B64D11/02; E03F1/00

EC Classification: B64D11/02, E03D11/02, E03F1/00C

Equivalents:

Cited Documents: US5604938; EP0903444; US3504381; JP11350574

Abstract

A toilet basin(2) is connected to a collecting tank via a suction valve and areas(2A,2B) of the system components in contact with pollutants are coated in a nanolayer(15). An independent claim is made for a process for manufacturing the toilet system in which a thin layer(15) is applied to the contaminant-contacting areas(2A,2B) using nanotechnology.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

USPS EXPRESS MAIL
EV 338 198 031 US
JULY 15 2003

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 063 167 A3

W. Erdmann et al.

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
20.03.2002 Patentblatt 2002/12(51) Int Cl.7: B64D 11/02, E03F 1/00,
E03D 11/02(43) Veröffentlichungstag A2:
27.12.2000 Patentblatt 2000/52

(21) Anmeldenummer: 00112925.3

(22) Anmeldetag: 20.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- Glenke, Torsten
25421 Pinneberg (DE)
- Heinrich, Hans-Jürgen
22609 Hamburg (DE)

(30) Priorität: 24.06.1999 DE 19928894

(71) Anmelder: Airbus Deutschland GmbH
21129 Hamburg (DE)(74) Vertreter: Hansmann, Dierk, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Hansmann-Klickow-Hansmann
Jessenstrasse 4
22767 Hamburg (DE)(72) Erfinder:
• Erdmann, Wolfgang
21614 Buxtehude (DE)

(54) Toilettensystem, insbesondere für Verkehrsmittel

(57) Bei einem Toilettensystem, insbesondere für Verkehrsmittel, wobei mindestens ein Toilettenbecken vorgesehen ist, welches über ein Absaugventil mit einem Sammelbehälter verbunden ist, besteht die Erfindung darin, dass die mit den abzuführenden Verunreinigungen in Kontakt kommenden Systemkomponenten mit einer "Dünnen Schicht", die mittels Nanotechnologie herstellbar ist, versehen sind.

Dabei ist insbesondere von Vorteil, dass eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Der gesamte Spülwasserbedarf kann erheblich verringert werden oder in der bevorzugten Ausgestaltung völlig entfallen, wobei eine hohe Reinigungs- und Hygienequalität erzielt wird. Das eingesparte Gewicht aufgrund des Wegfalls bzw. der Minimierung vom Spülwasser kann für die Erhöhung der Sitzkapazität im Transportmittel genutzt werden.

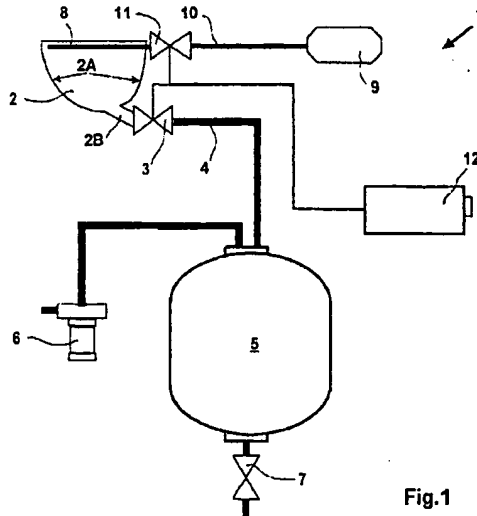


Fig.1

EP 1 063 167 A3

USPS EXPRESS MAIL
EV 338 198 0 1 US
JULY 15 2003



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 2925

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	US 5 604 938 A (TYLER STEVEN J) 25. Februar 1997 (1997-02-25) * Spalte 2, Zeile 62 - Spalte 3, Zeile 18 * * Spalte 5, Zeile 65 - Spalte 6, Zeile 22 * * Abbildungen 1., 1C *	1, 2, 4, 6-15	B64D11/02 E03F1/00 E03D11/02
Y	EP 0 903 444 A (ILLY BOB W) 24. März 1999 (1999-03-24) * Absätze '0003!-'0007! * * Absatz '0010! *	1, 2, 4, 6-15	
A	US 3 504 381 A (DEWEY DAVIS R) 7. April 1970 (1970-04-07) * Spalte 2, Zeile 27 - Zeile 59 * * Abbildungen *	1-3, 5-8	
P, X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 03, 30. März 2000 (2000-03-30) - & JP 11 350574 A (INAX CORP), 21. Dezember 1999 (1999-12-21) * Zusammenfassung *	1, 7, 8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			E03D C23C E03F A47K B64D B63B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Forscherort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 31. Januar 2002	Prüfer Urbahn, S
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/02 (P44C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 2925

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

31-01-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5604938	A	25-02-1997	US	2001034902 A1	01-11-2001
			US	5956780 A	28-09-1999
EP 0903444	A	24-03-1999	EP	0903444 A1	24-03-1999
			AU	8796598 A	12-04-1999
			WO	9915736 A1	01-04-1999
US 3504381	A	07-04-1970	KEINE		
JP 11350574	A	21-12-1999	KEINE		

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

AL



(11)

EP 1 063 167 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

27.12.2000 Patentblatt 2000/52

(51) Int. Cl.⁷: B64D 11/02, E03F 1/00

(21) Anmeldenummer: 00112925.3

(22) Anmeldetag: 20.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 24.06.1999 DE 19928894

(71) Anmelder: EADS Airbus GmbH

21129 Hamburg (DE)

(72) Erfinder:

- Erdmann, Wolfgang
21614 Buxtehude (DE)

• Glenke, Torsten

25421 Pinneberg (DE)

• Heinrich, Hans-Jürgen

22609 Hamburg (DE)

(74) Vertreter:

Hansmann, Dierk, Dipl.-Ing.

Patentanwälte

Hansmann-Klickow-Hansmann

Jessenstrasse 4

22767 Hamburg (DE)

(54) Toilettensystem, insbesondere für Verkehrsmittel

(57) Bei einem Toilettensystem, insbesondere für Verkehrsmittel,

wobei mindestens ein Toilettenbecken vorgesehen ist, welches über ein Absaugventil mit einem Sammelbehälter verbunden ist, besteht die Erfindung darin, dass die mit den abzuführenden Verunreinigungen in Kontakt kommenden Systemkomponenten mit einer „Dünnen Schicht“, die mittels Nanotechnologie herstellbar ist, versehen sind.

Dabei ist insbesondere von Vorteil, dass eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Der gesamte Spülwasserbedarf kann erheblich verringert werden oder in der bevorzugten Ausgestaltung völlig entfallen, wobei eine hohe Reinigungs- und Hygienequalität erzielt wird. Das eingesparte Gewicht aufgrund des Wegfalls bzw. der Minimierung vom Spülwasser kann für die Erhöhung der Sitzkapazität im Transportmittel genutzt werden.

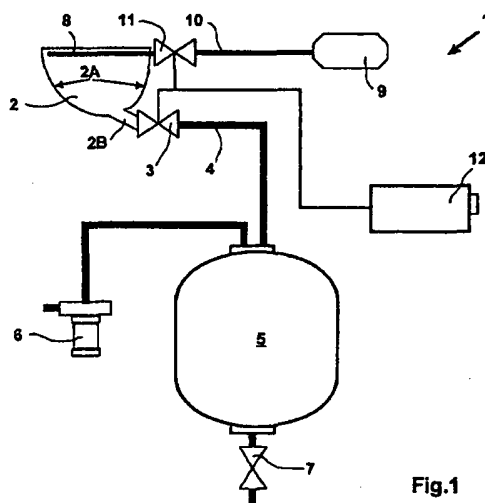


Fig.1

EP 1 063 167 A2

Beschr ibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Toilettensystem, insbesondere für Verkehrsmittel, wobei mindestens ein Toilett Becken vorgesehen ist, welches über ein Absaugventil mit einem Sammelbehälter verbunden ist.

[0002] Derartige Toilettensysteme, die insbesondere als Vakuumtoilettensysteme ausgebildet sind, werden in Verkehrsmitteln genutzt, die nur begrenzt Spül- und Abwasser transportieren können, was beispielsweise an Bord eines Flugzeuges der Fall ist. Alle bekannten Toilettensysteme nutzen zum Spülen des Toilett Beckens Spülflüssigkeit, wobei die Spülflüssigkeit Frischwasser sein kann oder zum Teil sogenanntes „Grauwasser“, d.h. Frischwasser, welches bereits in Handwaschbecken benutzt wurde.

So ist aus DE 42 01 986 eine Vakuumtoilette bekannt, die im wesentlichen ausgestattet ist mit einer Auslöseinrichtung, einem Spülwasserventil und einem Absaugventil, welches in einer Verbindungsleitung zwischen Toilett Becken und Sammelbehälter angeordnet ist. Mittels Steuereinrichtungen wird die Spülflüssigkeit nach Betätigung der Auslösvorrichtung dem Toilett Becken zugeführt, anschließend öffnet das Absaugventil und die im Toilett Becken enthaltenen Verunreinigungen werden zusammen mit der Spülflüssigkeit in den Sammelbehälter geleitet.

[0003] Aus einem Firmenprospekt der Firma sanivac Vakuumtechnik GmbH, 1997 ist ein Vakuumtoiletten-System beschrieben, wie es für die Schiffsausrüstung Anwendung findet. Auch hier ist aufgrund des Einsatzes der Vakuumtechnik möglich, eine Wassersparnis zu herkömmlichen WC's zu erzielen und zur Spülung mit ca. 1 l Spülwasser auszukommen. Auch teflonbeschichtete Oberflächen von Toilett Becken sind aus diesem Dokument bereits bekannt.

[0004] Aus DE 92 91 684 U1 ist eine Toilettenanordnung bekannt, wobei im Spülkreislauf neben einer Spülflüssigkeit auch ein Geruchsbindemittel bzw. Reinigungsmittel der Spülflüssigkeit zugesetzt wird. Damit wird erreicht, dass die Toilettenspülung effektiver gemacht und eine Geruchsbildung vermindert wird. Zu einer weiteren Erhöhung der Effektivität wird vorgeschlagen, dass die Toilettenschüssel mit einer Schicht aus Polytetrafluoräthylen (PTFE) versehen wird. Eine vereinfachte Reinigung von Fäkalienrückständen ist somit möglich.

[0005] Weiterhin sind aus EP 0 295 508 sowie 0 363 012 Vakuumtoilettensysteme bekannt, die zumindest teilweise „Grauwasser“ zum Spülen der Toilett Becken nutzen. Es ist hierbei notwendig, dass das bereits im Handwaschbecken genutzte Wasser mittels geeigneter Filtertechnik aufbereitet wird, um das Verstopfen der Spülwasserleitungen zu verhindern. Neben der notwendigen Steuerung des Spülprozesses ist hier eine Wasseraufbereitung notwendig. Insbesondere an Bord eines Flugzeuges ist eine Reduzierung der notwendigen Spülflüssigkeit von großer Bedeutung. Bei

Großraumflugzeugen, die bis zu 500 Passagiere transportieren können, muss für die Toilett benutzung eines jeden Passagiers entsprechende Spülflüssigkeit (Frischwasser bzw. „Grauwasser“) vorgesehen sein. Auch wenn bereits durch den bekannten Stand der Technik eine Vielzahl von Toilettensystem mit reduzierter Spülflüssigkeit bekannt sind, ist es jedoch gerade für Großraumflugzeuge, die bei entsprechenden langen Flugzeiten einen gewaltigen Wasserverbrauch aufweisen, notwendig, den Wasserverbrauch zu Spülzwecken auf ein Minimum einzuschränken. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Toilettensystem vorzusehen, welches eine Gewichtsreduzierung zu den bisherigen Lösungen ermöglicht und mit einer Minimierung der notwendigen Spülflüssigkeit bis gegen Null die Systemtechnik vereinfacht und somit insbesondere für die Anwendung in Großraumflugzeugen geeignet ist.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Toilettensystem mit den im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen gelöst.

[0007] Dabei ist insbesondere von Vorteil, dass eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Der gesamte Spülwasserbedarf kann erheblich verringert werden oder sogar völlig entfallen, wobei eine hohe Reinigungs- und Hygienequalität erreicht wird. Das eingesparte Gewicht aufgrund des Wegfalls bzw. der Minimierung vom Spülwasser kann für die Erhöhung der Sitzkapazität im Transportmittel genutzt werden.

[0008] Ein Verfahren zur Herstellung eines gattungsgemäßen Toilettensystems ist in Anspruch 8 angegeben.

[0009] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen 2 bis 7 sowie 9 bis 15 angegeben.

[0010] Dabei ist mit der Maßnahme gemäß Anspruch 2 insbesondere erreicht, dass gezielt in dem Bereich, der mit verunreinigenden Substanzen in Berührung kommt und der für einen Passagier zugänglich ist, ein Verschmutzen und Haften von Teilchen verhindert wird.

[0011] Ein weiterer Vorteil ergibt sich mit der Maßnahme gemäß Anspruch 3, da aufgrund des Wegfalls des Spülwasserkreislaufs sich die gesamte Systemtechnik vereinfacht und der Wartungsaufwand sich verringert.

[0012] Mit der Ausgestaltung nach Anspruch 4 ist es ermöglicht, im Bereich des Toilett Beckens ohne oder mit einem Minimum von Spülwasser gute Reinigungsleistungen zu erzielen.

[0013] Die Maßnahme gemäß des Anspruchs 5 ermöglicht eine gute Haltbarkeit der adhäsionshemmenden oder zumindest adhäsionsreduzierenden Schicht auf der Oberfläche von Systemkomponenten, vorzugsweise innerhalb des Toilett Beckens.

[0014] Die Maßnahme gemäß Anspruch 6 zeigt mehrere Alternativen zur Ausbildung der adhäsionshemmenden oder zumindest adhäsionsreduzierenden Schicht auf.

[0015] Die Maßnahmen gemäß der Ansprüche 9 und 10 zeigen vorteilhafte Verfahrensschritte zur Vorbehandlung der mit der Nanoschicht zu versehenen Systemkomponenten.

[0016] Die Maßnahmen gemäß der Ansprüche 11 und 12 zeigen jeweils ein mögliches Herstellungsverfahren zur Erzeugung der Nanoschicht auf.

[0017] Die Maßnahmen gemäß des Anspruchs 13 sehen alternative Herstellungsverfahren zur Erzeugung der erfindungsgemäßen Schicht vor.

[0018] Die Weiterbildungen gemäß der Ansprüche 14 und 15 geben eine vorteilhafte, unaufwendige Herstellungsmethode an.

[0019] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, das nachstehend anhand der Figuren 1 bis 5 näher beschrieben wird. In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0020] Es zeigt

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Vakuumtoilettensystems mit einer erfindungsgemäßen Toilettenschüssel,

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines Vakuumtoilettensystems mit einer erfindungsgemäßen Toilettenschüssel,

Fig. 3 und 4 eine Darstellung der unterschiedlichen Benetzungswinkel an der Oberfläche einer Toilettenschüssel in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschichtung und

Fig. 5 eine erfindungsgemäße Toilettenschüssel als Einzelheit mit einer Darstellung der Beschichtung.

[0021] In Fig. 1 ist schematisch ein Toilettensystem 1 gezeigt wie es in einem Flugzeug zur Anwendung kommen kann. Das Toilettensystem 1 umfasst im wesentlichen mindestens eine Toilettenschüssel 2, die über ein Abwasserventil 3 mit einer Sammelleitung 4 verbunden ist. Es ist möglich, dass mehrere Toiletten an unterschiedlichen Aufstellungsorten an eine Sammelleitung 4 angeschlossen sind. Die Sammelleitung 4 führt zu einem Sammelbehälter 5, in dem die Verunreinigungen bzw. das Abwasser gesammelt werden. Der Transportvorgang zwischen der Toilettenschüssel 2, in der sich die Verunreinigungen befinden, und dem Sammelbehälter 5 wird durch eine Druckdifferenz ermöglicht. Das Toilettensystem 1 ist dafür als Vakuumtoilettensystem ausgebildet. Ein Vakuumgenerator 6 erzeugt den notwendigen Unterdruck. Insbesondere für die Anwendung in einem Flugzeug ist aber auch die Nutzung des

herrschenden Unterdrucks während eines Fluges für das Vakuumtoilettensystem möglich. Der Sammelbehälter 5 weist weiterhin ein Tankentleerungsventil 7 auf, über das das gesammelte Abwasser bedarfsweis abgelassen werden kann. Zur Spülung der Toilettenschüssel 2 ist ein Spülring 8 vorgesehen, über den die Spülflüssigkeit in die Toilettenschüssel 2 geleitet wird und dort die Toilettenschüssel 2 reinigt. Die Spülflüssigkeit wird einem Spülflüssigkeitstank 9 entnommen, der über eine Zuführleitung 10 und einem Spülwasserventil 11 mit der zu reinigenden Toilettenschüssel 2 verbunden ist. Über eine Steuereinheit 12 werden die Ventile 3 und 11, d. h. das Abwasserventil und das Spülwasserventil geschaltet. Nach einer Toilettenbenutzung wird über eine Auslöseeinrichtung (nicht gezeigt) der Spülvorgang in Gang gesetzt, um die Fäkalien oder andere Verunreinigungen aus der Toilette in den Sammelbehälter 5 zu befördern. Die Steuereinheit 12 öffnet das Spülwasserventil 11, um Spülwasser über den Spülring 8 in die Toilettenschüssel 2 einzuleiten bzw. einzusprühen (beispielsweise mittels Sprühdüsen, um den Bedarf an Spülwasser so gering wie möglich zu halten). Das Abwasser (Fäkalien und Spülwasser) laufen aufgrund der Schwerkraft in den Auslauf 2B der Toilettenschüssel 2. Anschließend öffnet das Abwasserventil 3 für kurze Zeit und die im Bereich der Toilettenschüssel 2 angesammelten Substanzen werden aufgrund der Druckdifferenz in den Bereich der Sammelleitung 4 geführt und von dort in den Sammelbehälter 5 befördert. Das Spülwasser ist bei herkömmlichen Toilettensystemen notwendig, um die in der Toilettenschüssel 2 haften gebliebenen Verunreinigungen zu entfernen. Um diese Verunreinigungen mit nur einer Mindestmenge an Spülwasser bzw. ohne Spülwasser zu entfernen, wird als erfindungsgemäße Lösung vorgeschlagen, die Toilettenschüssel 2 mit einer speziellen Beschichtung 15 auszuführen. Die Beschichtung 15 ist erfindungsgemäß als Nanobeschichtung ausgeführt und innerhalb der Toilettenschüssel 2 zumindest in einem Bereich 2A aufgebracht, der mit verunreinigenden Substanzen in Berührung kommt. Der Aufbau und die Herstellungsweise der Schicht 15 wird näher in den Figuren 3 bis 5 gezeigt und in der dazugehörigen Figurenbeschreibung näher beschrieben. Die Beschichtung weist adhäsionshemmende oder zumindest adhäsionsreduzierende Eigenschaften auf. Die in Fig. 1 gezeigte erste Ausführungsform des Toilettensystems 1 verwendet eine nanobeschichtete Toilettenschüssel 2, die mit einer gegenüber herkömmlichen Toilettenschüsseln reduzierten Wassermenge zur Reinigung auskommt. Damit ist insbesondere für Großraumflugzeuge, die über lange Strecken fliegen, der notwendige Wasserbedarf für die Toilettenspülung erheblich reduziert und die freiwerdenden Gewichtskapazitäten können für zusätzliche Sitzplätze oder andere, den Komfort für die Passagiere erhöhende Maßnahmen genutzt werden. Auch können die benötigten Sammelbehälter 5 bzw. Spülwassertanks 11 volumenmäßig verkleinert werden, was eben-

falls zu einer Gewichtsreduzierung führt.

[0022] In Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform 20 eines erfindungsgemäßen Toilettensystems ersichtlich. In dieser Ausführungsform sind die Systemkomponenten des Toilettensystems 20 einer nanobeschichteten Toilettenschüssel 2 angepasst, an der keinerlei Verunreinigungen haften bleiben können. So kann völlig auf Spülflüssigkeit zur Reinigung der Oberfläche der Toilettenschüssel 2 verzichtet werden. Die Systemkomponenten Spülring 8, Spülflüssigkeitstank 9 (bzw. Frischwasserzuleitung), Zuführleitung 10 und Spülwasserventil 11 sind im Toilettensystem 20 nicht mehr vorhanden, was erheblich das gesamte Toilettensystem 20 vereinfacht und den Wartungsaufwand verringert. Die Toilettenschüssel 2 ist zumindest im Bereich 2A, in dem verunreinigende Substanzen mit der Oberfläche der Toilettenschüssel in Kontakt kommen mit der Nanoschicht 15 versehen. Durch Wegfall des Spülwasserventils 11 sind die Wartungsmaßnahmen für die Reinigung, Entkalkung und Austausch der Dichtelemente dieses Ventils 11 nicht mehr notwendig und die gesamte Systemzuverlässigkeit erhöht sich, da Undichtigkeiten im Spülwasserkreis entfallen. Darüber hinaus ergeben sich die schon zur ersten Ausführungsform genannten Vorteile.

Die weiteren Systemkomponenten sind identisch mit der Ausführungsform des Toilettensystems gemäß Fig. 1. Durch den Wegfall der Spülwasserzuführung ist eine vereinfachte Steuerung und damit eine Vereinfachung der Steuereinheit 12 erreicht. Für das Abführen der in der Toilettenschüssel 2 angesammelten Abfallprodukte ist nur noch das Öffnen und Schließen des Abwasserventils 3 notwendig und der Transport des Abfallproduktes wird zum größten Teil mittels der Absaugluft des innerhalb des Toilettensystems herrschenden Vakuums erreicht. Darüber hinaus wirkt sich aufgrund der minimalen Haftung von Verunreinigungen an der Oberfläche der Toilettenschüssel 2 die Schwerkraft vorteilhaft aus und nach dem Abtransport des Abfallproduktes ist die Toilettenschüssel 2 auch ohne Spülung sauber.

[0023] In den Figuren 3 und 4 ist ersichtlich, inwieweit sich durch eine Nanobeschichtung der Benetzungswinkel an der Oberfläche einer Toilettenschüssel 2 verringert.

In Fig. 3 ist eine herkömmliche Oberfläche 14 ohne Beschichtung oder mit einer bekannten, beispielsweise PTFE-beschichteten Toilettenschüssel gezeigt. Ein Wasser- bzw. Fäkalientropfen 13 befindet sich auf der Oberfläche 14 der Toilettenschüssel 2. Der Benetzungswinkel 13A ist relativ groß und somit ist eine Haftung des Tropfens 13 auf der Oberfläche 14 gegeben.

In Fig. 4 ist die Oberfläche 14 mit einer Nanobeschichtung 15 versehen. Die Nanobeschichtung 15 wird mittels Nano-Technologie erzeugt und auf der Oberfläche 14 aufgebracht. Sie wird näher in der nachfolgenden Fig. 5 gezeigt und deren Herstellung beschrieben. Die Nanobeschichtung 15 besitzt eine Schichtdicke im Nanometer-Bereich. Mittels der Nano-Technologie ent-

stehen geordnete Oberflächen, die zur Folge haben, dass bei Benetzung der Oberfläche der Benetzungswinkel 13B gegen 0° geht und somit eine bestmöglich erreichbare Antihafbeschichtung entsteht. Die Adhäsion der Wasser-bzw. Fäkalienteilchen 13 an der Nanobeschichtung 15 ist gehemmt oder zumindest wesentlich reduziert. Der Wasser- bzw. Fäkalientropfen 13 haftet nicht an einer solchen Oberfläche, wenn die Toilettenschüssel 2 gemäß der Figuren 1 und 2 damit beschichtet ist. Die Fäkalienteile bzw. -tropfen 13 fallen durch die Schwerkraft in den vorzugsweise ebenfalls beschichteten Auslauf 2B der Toilettenschüssel 2 und werden dann durch die Einwirkung des Vakuums über die Sammelleitung 4 in den Sammelbehälter 5 abgesaugt.

[0024] In Fig. 5 ist als Einzelheit eine erfindungsgemäße Toilettenschüssel 2 gezeigt. In der vergrößerten Darstellung 5A ist die Nanoschicht 15 auf der Oberfläche der Toilettenschüssel 2 in einer Schnittdarstellung ersichtlich. Vorzugsweise ist die Toilettenschüssel aus Edelstahl gefertigt, da zum einen Korrosion verhindert wird und andererseits dieses Material nicht spröde ist. Aber auch Kunststoffmaterialien sind für die Toilettenschüssel und weiteren Komponenten des Toilettensystems anwendbar.

Die Toilettenschüssel 2 ist in der gezeigten Ausführungsform mit einer Grundschrift 16 versehen. Eine solche Schicht 16 kann möglicherweise notwendig sein, wenn ein Aufbringen der Nanoschicht 15 auf das Grundmaterial der Toilettenschüssel Probleme - z.B. keine ausreichende Haftung bzw. zu hohe Rauigkeit - mit sich bringt und die Nanoschicht 15 auf der Grundschrift 16 besser erzeugt werden kann.

Alternativ dazu oder auch unterhalb der Grundschrift 16 ist in einer bevorzugten Ausführung eine Vorbehandlung der zu beschichtenden Oberfläche im Toilettent Becken vorgesehen. Die Oberfläche muss dafür geschliffen werden, um eine Oberflächenrauigkeit im Bereich von < 100 nm und eine Mittenrauigkeit im Bereich von < 10nm zu erreichen. Abschließend wird die Oberfläche mit einem organischen Lösungsmittel und/oder mittels Ultraschalleinwirkung gereinigt.

Im folgenden wird das Aufbringen der Nanoschicht 15 auf eine Toilettenschüssel 2 näher beschrieben.

Als Material zur Herstellung der Nanoschicht 15 eignen sich vorzugsweise Metalle oder Elemente der vierten Hauptgruppe des Periodensystems, insbesondere Cr, Ti, Mn, Ni, Ta, Al, V, W, Co, Be, Zr, Hf, Nb, Mo, C, Si, Ge oder Sn, oder Verbindungen mit den genannten Elementen. Es ist möglich, Verbindungen mit metallischen Bindungscharakter, insbesondere Karbide wie MC sowie Sekundärkarbide M_2C , M_3C , M_6C , M_7C , $M_{23}C_6$ zu verwenden, wobei hier das M als ein Metall oder für eine intermetallische Metallgruppe steht. Es ist weiterhin möglich, Nitride der Struktur MN oder Boride der Struktur MB zu verwenden, wobei das M wiederum für Metall steht.

[0025] Auch ist es möglich, die Nanoschicht 15 aus

einer Verbindung mit kovalentem Bindungscharakter, wie z.B. B_4C , SiC , BN , Si_3N_4 oder MoS_2 herzustellen.

[0026] Die Schicht 15 kann auch aus einer Verbindung mit ionischem Bindungscharakter wie zum Beispiel Al_2O_3 oder ZrO_2 oder BeO hergestellt werden. Desweiteren kann die Nanoschicht 15 auch aus einer Sialon-Verbindung oder aus Polymeren ausgebildet sein.

[0027] Die Erzeugung von „Dünnen Schichten“ bzw. „Ultradünne Schichten“, wie eine Nanobeschichtung auch genannt wird, kann neben der klassischen Aufdampfmethode mittels Widerstandsheizung durch vakuumgestützte Verfahren erfolgen. Die Anforderungen an die Herstellung von Schichten mittels der Nanotechnologie sind gekennzeichnet durch atomar scharfe Grenzflächen und die Kontrolle einer atomlagenweisen Deposition. Es handelt sich größtenteils um Vakuumverfahren, die entweder auf Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder Abscheiden aus der Gasphase basieren. Mögliche Herstellungsverfahren sind z.B.:

- Kathodenzerstäubung
- Ionenimplantierung
- Sputtertechnik (Plasmastrahlquelle, Magnetronzerstäubung, RF-Diodenzerstäubung)
- Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition - CVD-, Atomic Layer Epitaxy — ALE-, Chemical Beam Epitaxy — CBE-)
- PACVD- (Plasma assisted Chemical Vapor Deposition) Verfahren
- PVD- (Physical Vapor Deposition) Verfahren

[0028] Möglich ist es weiterhin, eine Antihafbeschichtung auf Basis von anorganischorganischen Nanokompositen mit niedriger Oberflächenenergie zu erzeugen. Eine solche Beschichtung kann durch bekannte Beschichtungstechnologien, wie Tauchen, Sprühen oder Schleudern, mit anschließender Härtung durch UV-Stahlung und/oder thermischen Einfluss erzielt werden, wobei Nanopartikel die gewünschten Antihafteigenschaften erzielen.

[0029] Bei den möglichen Verfahren zur Herstellung der Nanoschicht 15 ist es wesentlich, dass die Nanoschicht 15 eher weich und nicht-spröde ausgebildet wird. Damit wird verhindert, dass von der Toilettenschüssel 2 Teile der Nanoschicht 15 abblättern können. Als bevorzugtes Herstellungsverfahren ist die Magnetron-Sputter-Technik vorgesehen. Diese, dem Fachmann bekannte Technik gehört zur Verfahrensgruppe der Kathodenzerstäubung, bei der im Vakuum die Beschichtung aufgebracht und ein fester Untergrund mit metallischen bzw. nichtmetallischen Schichten versehen wird. Das Beschichtungsmaterial auf den Kathoden wird durch Beschuß mit Gasionen in einer Gasatmosphäre zerstäubt und schlägt sich auf der Toilettenschüssel-Oberfläche als Schicht nieder. Die Ionen sorgen dafür, dass die oberen Atomschichten aus dem Beschichtungsmaterial durch Impulsaustausch in den

gasförmigen Zustand überführt werden. Das nun im gasförmigen Zustand vorliegende Beschichtungsmaterial scheidet sich dann auf der zu beschichtenden Fläche ab.

[0030] Mit dieser Magnetron-Sputter-Technik ist die thermische Belastung der zu beschichtenden Toilettenschüssel relativ gering. Mit dem Einsatz einer Doppelring-Magnetronquelle sind derzeit Beschichtungsdurchmesser bis zu 150 mm möglich mit einer Beschichtungsrate von 0,1 bis 1 mm/min.

[0031] In der bisher gezeigten Ausführungsform ist die Nanobeschichtung der Toilettenschüssel 2 näher beschrieben worden. Es ist möglich, daß mit geeigneten Aufbringungsmethoden auch andere Systemkomponenten, die mit Fäkalien bzw. Verunreinigungen in Kontakt kommen, mit einer Nano-Schicht versehen werden. So ist beispielsweise eine Beschichtung der Sammelleitung 4 bzw. zumindest von Teilen der Sammelleitung 4, wie Abzweigungen, denkbar, um den Reinigungsaufwand des Toilettensystems so gering wie möglich zu halten.

Patentansprüche

1. Toilettensystem (1;20), insbesondere für Verkehrsmittel, wobei mindestens ein Toilett Becken (2) vorgesehen ist, welches über ein Absaugventil (3) mit einem Sammelbehälter (5) verbunden ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** zumindest teilweise die mit den abzuführenden Verunreinigungen in Kontakt kommenden Systemkomponenten mit einer Nanoschicht (15) versehen sind.
2. Toilettensystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Oberfläche des Toilett Beckens (2) zumindest in Bereichen (2A, 2B), die mit verunreinigenden Substanzen in Berührung kommen, mit der Nanoschicht (15) versehen ist.
3. Toilettensystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Toilettensystem (20) ohne Spülwasserkreislauf ausgebildet ist.
4. Toilettensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** zumindest teilweise Absaugluft, die nach dem Öffnen des Absaugventils (3) in das Toilett Becken (2) gelangt, zum Reinigen des Toilett Beckens vorgesehen ist.
5. Toilettensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Oberfläche des mit der Nanoschicht (15) vorgesehenen Bereichs (2A, 2B) mit einer Grundschicht (16) versehen ist, auf die die Nanoschicht (15) auf-

bringbar ist.

Oberfläche aufgebracht wird.

6. Toilettensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nanoschicht (15) aus einem Metall oder einem Element der vierten Hauptgruppe des Periodensystems oder einer Verbindung mit kovalentem Bindungscharakter oder aus einer Verbindung mit ionischem Bindungscharakter oder aus einer Silion-Verbindung oder aus einem Polymer besteht. 5
7. Toilettenbecken zur Verwendung in einem Toilettensystem gemäß der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Toilettenbecken (2) zumindest bereichsweise mit der Nanoschicht (15) versehen ist, wobei die Schicht (15) als „Dünne Schicht“ mittels Nanotechnologie erzeugbar ist. 15
8. Verfahren zur Herstellung eines Toilettensystems nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Beschichtung zumindest teilweise auf die mit den abzuführenden Verunreinigungen in Kontakt kommenden Bereiche (2A, 2B) der Systemkomponenten aufgebracht wird, wobei die Schicht (Nanoschicht 15) als „Dünne Schicht“ mittels Nanotechnologie erzeugt wird. 20 25
9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberfläche der mit der Nanoschicht (15) vorgesehenen Bereiche (2A, 2B) der Systemkomponenten, beispielsweise des Toilettenbeckens (2), mit einer Grundsicht (16) versehen wird, auf die die Nanoschicht (15) aufgebracht wird. 30 35
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberfläche der Bereiche (2A, 2B) mittels Schleifen und Reinigen vorbehandelt wird. 40
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nanoschicht (15) mittels Kathodenzerstäubung aufgebracht wird. 45
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Aufbringen der Nanoschicht (15) ein Magnetron-Sputter-Verfahren eingesetzt wird. 50
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nanoschicht (15) durch Ionenimplantieren oder Sputtertechnik oder Gasphasenabscheidung (CVD-Prozeß, PACVD-Prozeß) oder Physical Vapor Deposition-Verfahren (PVD-Prozeß) auf die 55
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Aufbringen der Nanoschicht (15) übliche Beschichtungsverfahren, wie Tauchen, Sprühen oder Schleudern, mit Einbringen von Nanopartikeln eingesetzt werden.
15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Beschichtungsprozess eine Härtung durch UV-Strahlung und/oder thermischen Einfluss durchgeführt wird.

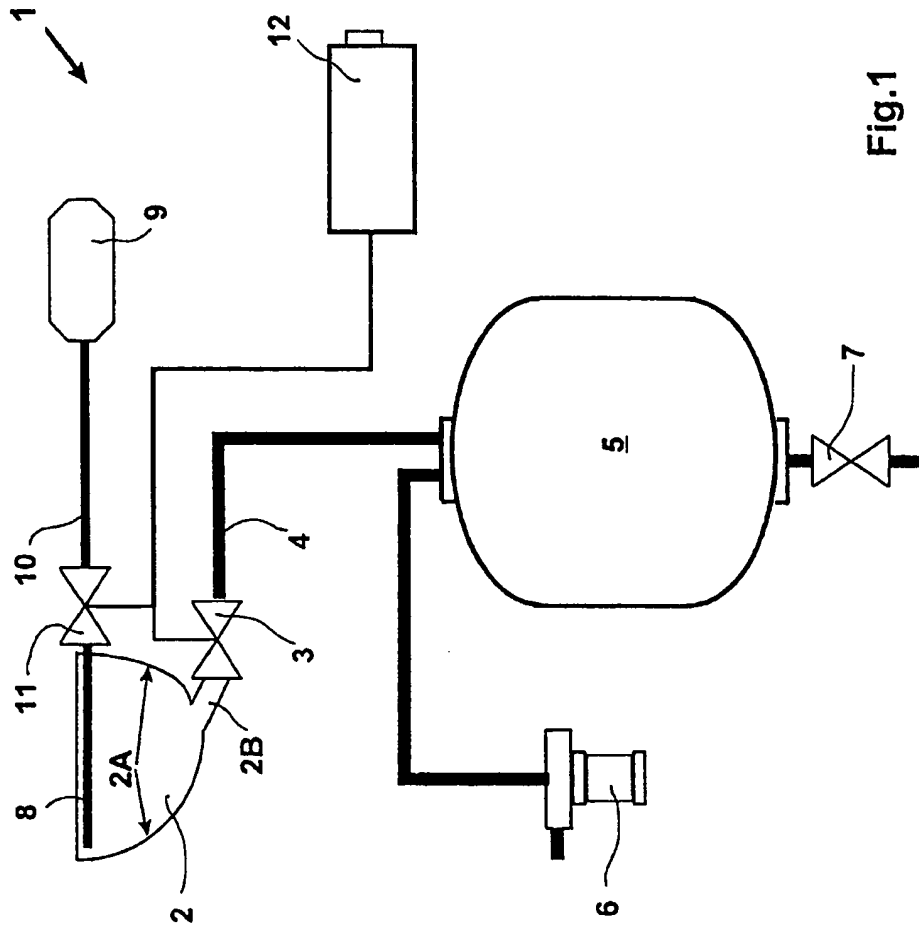


Fig.1

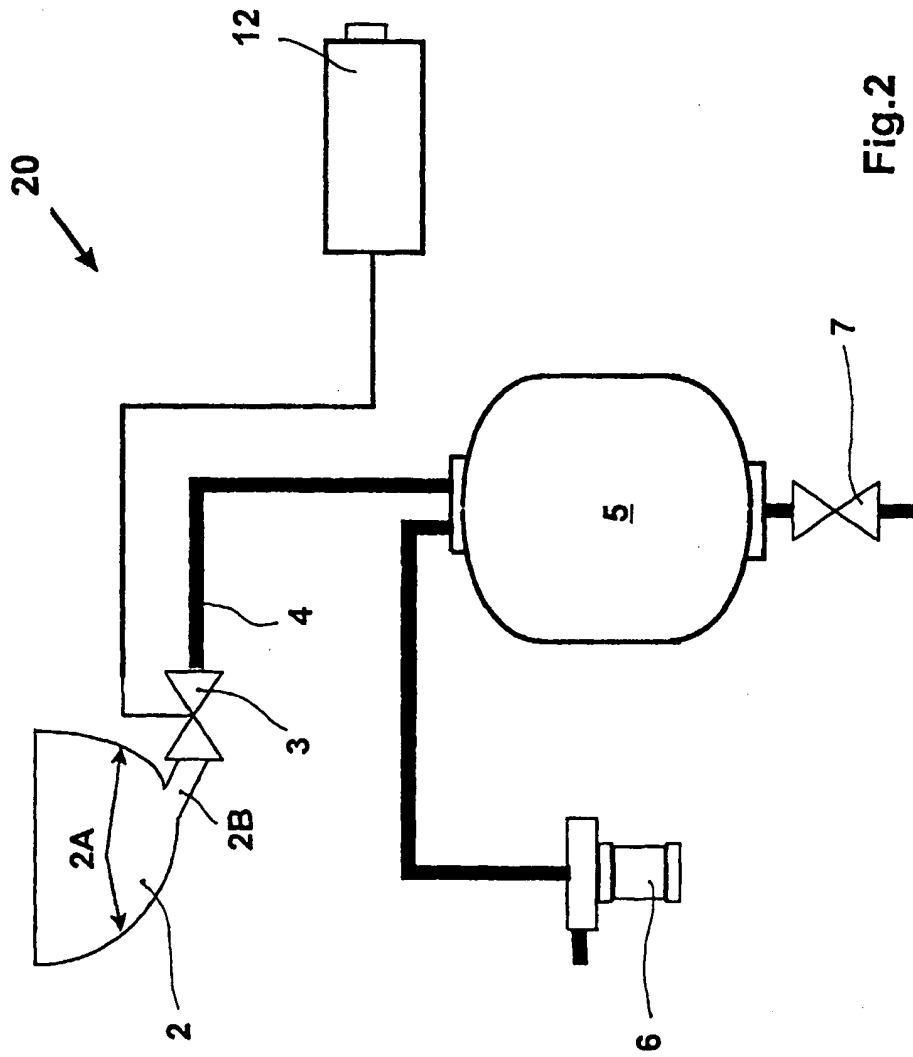


Fig.2

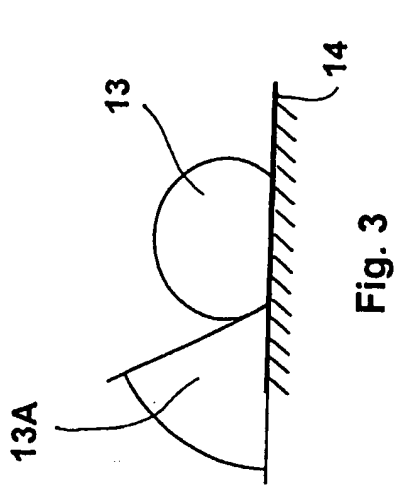


Fig. 3

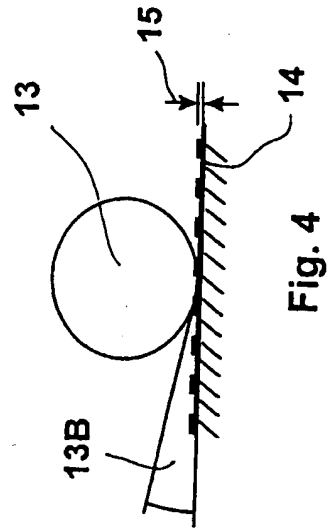


Fig. 4

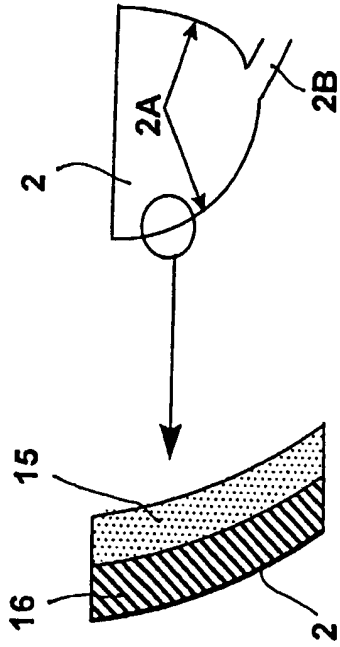


Fig. 5A

Fig. 5